

他に分類されない粒子線または電離放射線の取扱い技術;照射装置;ガンマ線またはX線顕微鏡[2]

注

このサブクラスにおいては、下記の用語は以下に示す意味で用いる:

「粒子」は、分子、原子または原子以下の大きさの粒子を意味する。[2012.01]

- 1/00 粒子または電離放射線の取扱い装置, 例. 集束または減速 (電離放射線フィルター G21K3/00; 中性子, 荷電粒子, 中性分子ビームまたは中性原子ビームの発生または加速 H05H3/00 から H05H15/00) [2]
- E 電子線の発生, 取扱い (照射装置は G21K5/04)
- A 原子線, イオン線の発生, 取扱い (照射装置は G21K5/04)
- X X線の取扱い (照射装置は G21K5/02, 発生用ターゲットの保持具は G21K5/08)
- N 中性子の取扱い (照射装置は G21K5/02, 発生用ターゲットの保持具は G21K5/08)
- R RIの取扱い (照射装置は G21K5/02)
- Z その他のもの
- 1/02
 - ・絞り, コリメーターを用いるもの[2]
- R 照射範囲を限定するためのもの, 例. 絞りまたはツープス
- C 照射をそろえるためのもの, 例. コリメータ, スリットまたはモノクロメータ
- G ・マルチホール, グリッド
- M 製造方法, 材質
- Z その他のもの
- 1/04
 - ・可変絞り, シャッター, チョッパーを用いるもの[2]
- R 照射範囲を限定するもの
- D ・井桁状のもの
- T ・3以上の自由度を有するもの
- P 強度を変えるためのもの
- S シャッター, チョッパー
- Z その他のもの
- 1/06
 - ・回折, 屈折または反射を用いるもの, 例. モノクロメーター (G21K1/10, G21K7/00 が優先) [2]
- A 回折, 屈折または反射をさせるもの自体
- B ・回折, 屈折または反射させるものの形状, 構造に特徴のあるもの
- C ・材質に特徴のあるもの
- D ・製造方法に関するもの
- F モノクロメーター等, 回折, 屈折または反射をさせるものを組み込んだ装置
- G ・装置の構成, 配置
- K ・可動部に特徴のあるもの
- L ・ゴニオメータに関するもの

- M ・ミラー部
- N ・ミラーの交換, 切替, わん曲装置
- P ・ミラーに付属する装置, 例. ホルダー
- S ・スリット部
- T ・可動部, ミラー部, スリット部以外の細部, 例. コリメーター
- Z その他のもの
- 1/08
 - ・電氣的または磁氣的手段によるビーム偏向, 集中または集束 (電子管の電子光学装置 H01J29/46) [2]
- 1/087
 - ・電氣的手段によるもの[4]
- F ビームの集束
- D ビームの偏向
- S ビームの走査
- Z その他のもの
- 1/093
 - ・磁氣的手段によるもの[4]
- F ビームの集束
- D ビームの偏向 (G21K1/093 F 優先)
- S ビームの走査
- Z その他のもの
- 1/10
 - ・散乱装置; 吸収装置[2]
- S 散乱装置
- A 吸収装置
- Z その他のもの
- 1/12
 - ・共鳴吸収体またはそのための駆動機構, 例. メスバウワー効果装置[3]
- 1/14
 - ・電荷交換装置を用いるもの, 例. ビームの電荷の中性化または極性を変えるためのもの[3]
- 1/16
 - ・分極化装置を用いるもの, 例. 分極したイオンビームを得るためのもの[3]
- 3/00 電離放射線フィルター, 例. X線フィルター [2]
- E 特性補償 [例. イコライザー]
- S スペクトル特性補償
- W 減衰 [例. ウェッジフィルター]
- M 製造方法, 材質
- Y X線, γ線以外に使用
- Z その他のもの [フィルター切替え, 取付け等, 細部を含む]
- 4/00 粒子または電離放射線の空間分布を可視像に変換するための変換スクリーン, 例. 蛍光スクリーン[3]
- A 粒子または電離放射線の入射とほぼ同時に可視像情報 [例えば光] を出力するもの; 例. 蛍光スクリーン, 増感紙
- B ・混入, 或いは塗付される蛍光体に特徴のあるもの [蛍光体そのものは C09K11/00]
- C ・光以外の情報を出力するもの
- K スクリーンからの情報を取り出す為に, 検出される X線または粒子線とは別の刺激 [例えばレーザー光] を加えるもの
- L ・レーザー光を照射するもの; 例. 放射線像

G 2 1 K

	変換パネル〔輝尽性蛍光体を用いたもの、イメージングプレート（IP）	N	中性子発生のためのもの〔H05H6/00 も付与する〕
M	・ 蛍光体の特徴のあるもの〔蛍光体そのものは C09K11/00 〕	X	X 線発生のためのもの〔照射装置は 5/02, 取扱いは 1/00〕
N	・ 構造, 蛍光体以外の混入物に特徴のあるもの	R	RI 製造用〔主分類は G21G1/10〕
Z	その他のもの	Z	その他のもの
5/00	照射装置（照射を容易にするための原子炉の適用 G21C23/00; 照射のための放電管 H01J33/00, H01J37/00）〔2〕	5/10	・ ビーム線源と被照射物体間に相対運動を生じるもの〔3〕
M	複数線種のためのもの〔主として X 線と電子線〕	C	コンベアによるもの
S	安全装置, 防護装置	T	回転テーブルによるもの
B	照射室の雰囲気に関するもの	L	被照射体が線状のもの
W	照射窓に特徴のあるもの〔膜の成分を含む〕	S	被照射体がシート状, テープ状のもの〔主として塗膜硬化, 乾燥〕
C	・ 気体による照射窓の冷却〔フィルターの冷却を含む〕	F	被照射体が流動体のもの〔流体による移送を含む〕
D	・ 気体以外による照射窓の冷却〔フィルターの冷却を含む〕	M	線源が移動するもの〔主として医療用〕
E	・ 窓の交換に関するもの〔フィルターの交換を含む〕	Z	その他のもの
R	照準合わせ, 視野, 位置決め	7/00	ガンマ線または X 線顕微鏡〔2〕
A	付属装置〔制御, 信号処理を含む〕		
Z	その他のもの		
5/02	・ ビーム形成手段をもたないもの〔2〕		
X	X 線照射装置		
N	中性子照射装置〔ターゲットによる発生照射装置を含む〕		
R	RI 線源による照射装置		
A	・ アプリケーター		
W	・ 複数の放射線源を有するもの		
Z	その他のもの		
5/04	・ ビーム形成手段をもつもの〔2〕		
E	電子線照射装置		
M	・ 電子顕微鏡, 電子線露光装置, 溶接装置に関係するもの		
F	・ フィラメント, 電極に関するもの		
A	イオンビーム照射装置〔イオン注入を含む〕		
W	複数の照射源を有するもの〔複数線種 H05H5/00〕		
C	ビーム位置, ビーム電流の検出, 制御に関するもの		
D	加速器からの荷電粒子の取り出し		
S	偏向, 反射等によって被照射体全面を照射するもの		
Z	その他のもの		
5/08	・ 照射されるターゲットまたは物体の保持具〔2〕		
A	被照射体用の照射用カプセル, 気送用カプセル		
B	線源用の照射用カプセル, 気送用カプセル		
C	ターゲットの冷却〔X 線発生電極の冷却も含む〕		